

G12 DÉTAILS OU PARTIES CONSTITUTIVES DES INSTRUMENTS

G12B DÉTAILS OU PARTIES CONSTITUTIVES D'INSTRUMENTS OU DÉTAILS OU PARTIES CONSTITUTIVES COMPARABLES D'AUTRES APPAREILS, NON PRÉVUS AILLEURS

Notes

- (1) La présente sous-classe couvre uniquement les détails qui ne sont pas limités aux instruments de mesure ou à tout appareil couvert par une seule sous-classe.
- (2) La présente sous-classe ne couvre pas:
 - les détails couverts par l'une des sous-classes des sections A, F, G ou H. En particulier, les détails qui sont limités aux instruments de mesure sont couverts par les sous-classes appropriées de G01, p.ex. G01D;
 - les détails structurels limités aux appareils électriques, p.ex. boîtiers, blindages, qui sont couverts par H05K ou les sous-classes correspondantes de la section H.
- (3) Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la section G, spécialement en ce qui concerne la définition de l'expression "mesure" dans la note (2) qui suit le titre de la classe G01.

Schéma général

ÉLÉMENTS SENSIBLES PRODUISANT UN MOUVEMENT OU UN DÉPLACEMENT;		HABILLAGE OU SUPPORTS; ÉLÉMENTS	
DÉTAILS DE MOUVEMENT	1/00; 3/00	INDICATEURS	9/00; 11/00
RÉGLAGE DE POSITION OU D'ATTITUDE; COMPENSATION DE TEMPÉRATURE	5/00; 7/00	ÉTALONNAGE.....	13/00
		REFROIDISSEMENT; ÉCRANS.....	15/00; 17/00
		DÉTAILS D'APPAREILS UTILISANT DES TECHNIQUES DE SONDE À BALAYAGE.....	21/00

1/00	Eléments sensibles capables de produire un mouvement ou un déplacement à des fins non limitées à la mesure; Mécanismes de transmission associés correspondants	9/08	. Supports; Dispositifs pour le transport
1/02	. Bandes ou plaques composées, p.ex. bimétalliques (thermomètres utilisant des éléments bilames G01K 5/62)	9/10	. . Tableaux d'instruments; Panneaux; Pupitres; Baies; Châssis
1/04	. Corps creux ayant des parties déformables ou déplaçables sous l'effet de la pression, p.ex. tube de Bourdon, soufflets (soufflets en général F16J 3/00)	11/00	Eléments indicateurs; Leur éclairage
3/00	Détails de mouvements non prévus ailleurs (détails d'appareils utilisant des techniques de sonde à balayage G12B 21/00; amortissement de chocs ou de vibrations en général F16F; moyens d'éviter le déséquilibre des forces F16F 15/00; essais d'équilibrage G01M) [1,7]	11/02	. Echelles; Cadres
3/02	. Immobilisation des mouvements, c. à d. blocage des mouvements quand ils ne sont pas utilisés	11/04	. Index; Mécanismes de réglage correspondants
3/04	. Suspensions (paliers F16C)	13/00	Étalonnage des instruments ou appareils (étalonnage des instruments de mesure G01)
3/06	. Réduction des effets de frottement, p.ex. par vibration (par lubrification F16N)	15/00	Refroidissement (par réfrigération, p.ex. circulation d'un fluide réfrigéré, F25D; détails d'échangeurs de chaleur ou de dispositifs de transport de chaleur d'application générale F28F)
3/08	. Amortissement de mouvements, p.ex. pour éviter les oscillations au moment de la lecture	15/02	. par des systèmes de circulation de fluide à circuit fermé
3/10	. . utilisant les courants de Foucault	15/04	. par des courants de fluide; p.ex. air, en circuit ouvert
5/00	Réglage de la position ou de l'attitude, p.ex. niveau d'instruments ou d'autres appareils, ou de leurs parties constitutives (niveaux en soi G01C 9/00); Compensation des effets d'inclinaison ou d'accélération, p.ex. pour appareils d'optique	15/06	. par contact avec des masses absorbantes ou rayonnantes de la chaleur, p.ex. bain réfrigérant
7/00	Compensation des effets de température (par refroidissement G12B 15/00)	17/00	Ecrans (isolation ou autres protections des bâtiments E04B; protection d'urgence des appareils en général F16P 7/00; se rapportant aux ondes sonores G10K 11/00; se rapportant aux radiations nucléaires G21F)
9/00	Habillage ou supports d'instruments ou d'autres appareils	Note	Le présent groupe <u>couvre</u> : – la protection des instruments ou autres appareils contre les rayonnements ou autres influences extérieures; – les mesures préventives contre l'émission de rayonnements indésirables ou autres influences par les instruments ou autres appareils.
9/02	. Boîtiers; Habillage; Habitacles (dispositifs d'étanchéité pour les organes de transmission F16J, particulièrement F16J 15/50)	17/02	. contre les champs électriques ou magnétiques, p.ex. ondes radio
9/04	. . Détails, p.ex. couvercle		
9/06	. . . Boîtiers métalliques		

G12B

- 17/04 . contre la lumière ultraviolette, visible ou infrarouge (écrans pour dispositifs d'éclairage F21V; filtres optiques G02B 5/20)
 - 17/06 . contre la chaleur (G12B 17/04 a priorité; refroidissement G12B 15/00)
 - 17/08 . contre les influences produisant des dommages mécaniques, p.ex. causés par une explosion, par un objet extérieur, par une personne (G12B 17/02 à G12B 17/06 ont priorité)
- 21/00 Détails d'appareils utilisant des techniques de sonde à balayage [7]**

Notes

- (1) Dans le présent groupe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: [7]
 - "sonde" désigne un dispositif d'interface, p.ex. une aiguille avec une extrémité en pointe, définissant une zone transductrice où se produit une interaction, p.ex. la génération d'un courant d'effet tunnel, lorsque la sonde se trouve à proximité immédiate d'une surface. [7]
- (2) Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe B81 et de la sous-classe B81B concernant les "dispositifs à microstructure" et les "systèmes à microstructure", ainsi que des notes qui suivent le titre de la sous-classe B82B concernant les "nanostructures". [7]
- (3) Une liste d'endroits, où sont prévues des adaptations particulières utilisant des techniques de sonde à balayage, figure ci-dessous: [7]

B82B	3/00	Fabrication ou traitement des nanostructures
------	------	--

- | | | |
|------|-------|--|
| C23C | | Traitement de surface de matériaux métalliques |
| G01B | | Mesure de dimensions |
| G01N | 13/10 | Recherche ou analyse des structures de surface à l'échelle atomique |
| G11B | 9/12 | |
| G11B | 11/24 | |
| G11B | 13/08 | Enregistrement ou reproduction de l'information |
| H01J | 37/00 | Tubes à décharge pourvus de moyens permettant l'introduction d'objets ou d'un matériau à exposer à la décharge |
| H01L | | Procédés ou appareils spécialement adaptés au traitement de dispositifs à semi-conducteurs ou de dispositifs à l'état solide |

- | | |
|-------|--|
| 21/02 | . Sondes [7] |
| 21/04 | . . Sondes à effet tunnel [7] |
| 21/06 | . . Sondes optiques à champ proche [7] |
| 21/08 | . . Sondes à forces atomiques [7] |
| 21/10 | . . Sondes à forces magnétiques [7] |
| 21/12 | . . Sondes à forces électrostatiques [7] |
| 21/20 | . Dispositions pour le balayage ou le positionnement [7] |
| 21/22 | . . Détails structurels [7] |
| 21/24 | . . Compensation des erreurs induites par la température ou les vibrations [7] |